

ヘリウムガスの消費量削減ソリューション

ヘリウムガス不足による価格高騰が予想される今、ヘリウム消費量の削減ニーズが高まっております。アジレントでは、様々なソリューションを提供しております。

詳細はこちら <https://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1002592>



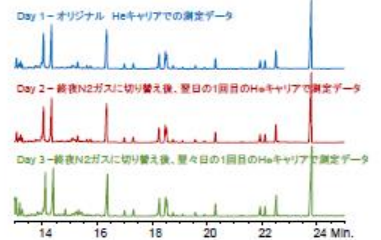
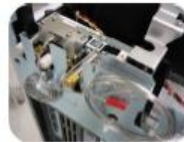
ガス消費量削減ソリューション

✓ **ガスセーバー** 注入時以外のスプリットベントからの排出量を削減します。



✓ **キャリアガス切替スイッチ**

スタンバイ時に自動で窒素ガスに切り替えます。詳細は別途リーフレットをご参照ください。「キャリアガス切替スイッチによるヘリウム消費量の削減」

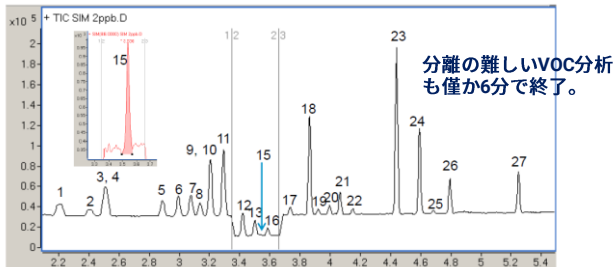


代替ガスソリューション

✓ **水素ガスの使用** 速度論上に最も分離に優れる水素ガスをキャリアガスに使用できます。

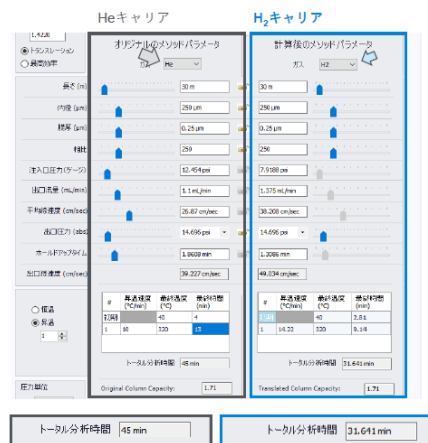
○測定時間が短縮されるほか、GC/MSにも使用できます。

水素キャリアGC/MSによるVOC, 1,4-ジオキサンの一斉分析例



7697A(HSS)-7890B/5977A (InertPlusイオン源)
キャリアガス: 水素、HSS用加圧ガス: 窒素

○メソッドトランスレーションにより簡単にHeキャリアの測定条件を変更できます。



分析時間を2/3に短縮。

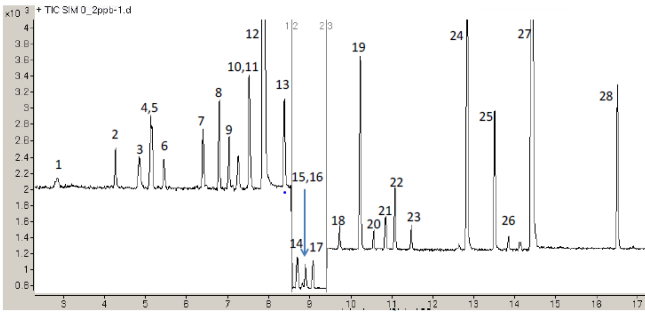
○ガス漏れ等の万一の事態に備えた安全設計となっております。

- Safety Shutdown** : 水素が設定圧力にならない場合、EPCバルブおよびヒーターがシャットダウン
- Flow Limiting Frit** : EPCバルブがオープン状態で不具合をおこしても、Inlet Fritにより流量が制限
- Oven ON/OFF Sequence** : オープンヒーターがONになる前に、オープンファンによりオープン内を排気
- Explosion Test** : 万が一、水素がGCオープン内で爆発しても、ドアや構造体が飛び散らない設計
- Method Translation** : 簡単に水素キャリア (窒素キャリア) の分析条件に変換できる独自のソフトウェアを提供可能
- H2センサー (オプション)** : GCオープン内に水素のリークを検知するとGC本体がシャットダウン



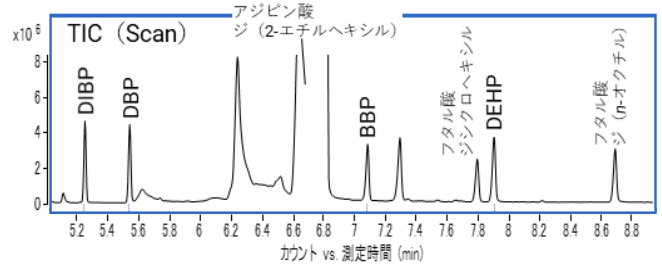
✓窒素ガスの使用 水素ガスの他、窒素ガスを用いたアプリケーションも豊富にございます。

窒素キャリアGC/MSによるVOC, 1,4-ジオキサンの一斉分析例



Atomx P&T-7890B/5977A (InertPlusイオン源)
キャリアガス、P&Tバージガス：窒素

窒素キャリアを用いた熱抽出-GC/MSによるフタル酸エステル分析

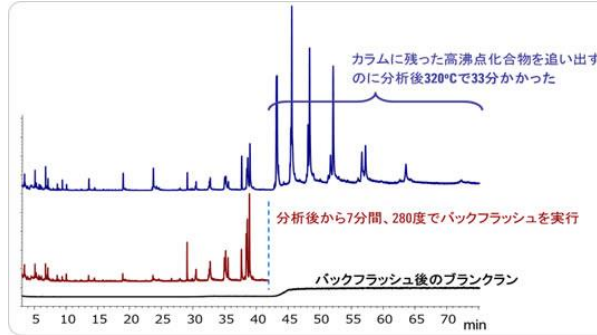


高速分析ソリューション

✓高速高分離カラム 内径0.18 mmの細いカラムを用いることで分離を保ったまま分析時間を短縮できます。

✓キャピラリー・フロー・テクノロジー(CFT)

○バックフラッシュにより焼き出し時間を短縮します。



○その他、CFTは豊富な使用用途がございます。

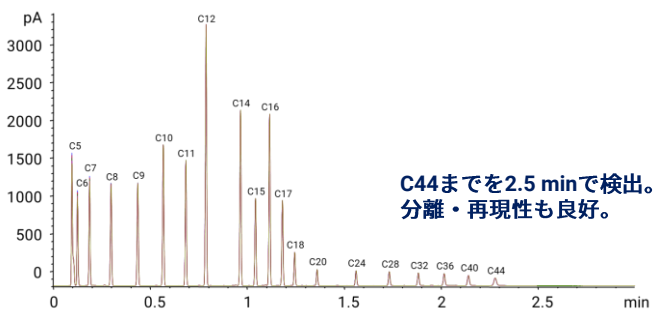
- カラム出口の分割 (複数の検出器による同時分析)
- カラムフローの合流 (2本のカラムを常設)
- GC/MSのカラム交換 (大気開放が不要)
- バックフラッシュ (焼き出し時間の短縮)
- 2D-GC/Dean's スイッチ (特定の画分を2ndカラムに)
- Comprehensive GC×GC (すべての画分を2ndカラムに)

✓Intuvo 9000 GCによる高速昇温

昇温速度は最高250°C/min。ダイレクトヒーティングにより超高速加熱でも完璧な再現性を実現します。



従来品は全く異なる新設計



ASTM D7798 SimDisの標準品を5回注入した重ね書き

○Intuvo GCを用いたアプリケーションも続々と増えております。
対応分野
石油・エネルギー、材料、水道、環境、水道等

詳細、価格などは、弊社担当営業までお問い合わせください。

アジレント・テクノロジー株式会社
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
フリーダイヤル 0120-477-111 www.agilent.com/chem/jp

